



Avazbek DEXQONOV,

O'zMU Fizika fakulteti tayanch doktoranti  
E-mail: dexqonovavazbek1993@gmail.com

Gulmurza ABDURAXMONOV,  
O'zMU Fizika fakulteti proffessori

Fizika-matematika fanlari doktori, professor B.Umirzakov taqrizi asosida

## PHYSICAL PARAMETERS OF SILICATE GLASS DIFFUSED WITH RuO<sub>2</sub>

Anotatsiya

This article discusses the diffusion processes, diffusion zones, percolation theory, activation energies, and their analysis based on the results of diffusing metal oxides, primarily RuO<sub>2</sub>, into lead silicate glass under various conditions. The doping of silicate glass significantly alters all its physical parameters. The obtained results can lead to important innovations in the development of thick-film resistors, various strain sensors, and cost-effective thermoelectric materials. The physics of this process has been extensively explored in this study.

**Key words:** diffusion zone, lead-silicate glass, ruthenium dioxide, specific resistance, percolation theory, nanocrystals, structural transitions, infinite cluster.

## ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА, ДИФФУЗИРОВАННОГО С RuO<sub>2</sub>

Аннотация

В данной статье рассматриваются процессы диффузии, диффузионные зоны, теория перколяции, энергии активации и их анализ на основе результатов диффузии оксидов металлов, главным образом RuO<sub>2</sub>, в свинцово-силикатное стекло при различных условиях. Легирование силикатного стекла приводит к значительным изменениям всех его физических параметров. Полученные результаты могут открыть новые перспективы в разработке толстопленочных резисторов, различных тензодатчиков и доступных термоэлектрических материалов. Физика этого процесса детально исследована в рамках данной работы.

**Ключевые слова:** зона диффузии, свинцово-силикатное стекло, диоксид рутения, удельное сопротивление, термоЭДС, теория перколяции, нанокристаллы, структурные переходы, бесконечный кластер.

## RuO<sub>2</sub> BILAN DIFFUZYALANGAN SILIKAT SHISHANING FIZIK PARAMETRLARI

Annotatsiya

Ushbu maqolada qo'rg'oshin silikat shishaga metal oksidlari asosan RuO<sub>2</sub> bilan turli sharoitlarda diffuziyalash natijalari asosida uning diffuziya jarayonlari, diffuziya zonalari, sizib o'tish nazariysi, aktivatsiya energiyalari hamda uning tahlillari haqidagi so'z boradi. Silikat shisha legirlash natijasida uning barcha fizik parametrлari tubdan o'zgaradi. Olingan natijalar orqali qalin qatlamlari rezistorlar, turli tenzo datchiklar, arzon termoelektrik materiallar olishda muhim yangi natijalar olish mumkin. Bu jarayon fizikasi keng miqyosda ochib berishga harakat qilingan.

**Kalit so'zlar:** diffuziya zonasasi, qo'rg'oshin-silikat shisha, ruteniy dioksid, solishtirma qarshilik, termoEYuK, sizib o'tish nazariysi, nanokristalllar, struktura o'tishlari, cheksiz klaster.

**Kirish.** Legirlashgan shishaning elektr o'tkazuvchanligini ta'minlashda legirllovchi metall atomlarining to'g'ridan-to'g'ri ishtiroy etishiga qarshi asosiy dalil sifatida bu metallarni qo'rg'oshin-silikat shishasida past eruvchanlikka ega ekanligi ko'rsatiladi. Misol sifatida, [1] ishida EXAFS usuli va rentgen difraktsiyasi yordamida o'tkazilgan tadqiqotlarni batafsil ko'rib chiqamiz. Ushbu tadqiqotlarda dastlab RuO<sub>2</sub> qismasi shishada erishi, ammo keyinchalik sovutish jarayonida klasterlar shaklida cho'kib qolishi aniqlangan. Ushbu klasterlarning o'lchami 20-30 Å deb baholangan va RuO<sub>2</sub> kukuni yuzasining mayda zarraliga kamaygan sari ularning o'lchami oshgan. Kuzatilgan elektr hosil bo'shligi ushbu klasterlarning hosil bo'shlisi bilan izohlanadi. Bunda Adachi [2] ishi asosida RuO<sub>2</sub> va shisha o'zaro ta'sirining asosiy mexanizmi diffuziya emas, balki erish jarayoni ekani ta'kidlanadi.

Biroq, yanada chuqurroq tahlil shuni ko'rsatadiki, 20-30 Å o'lchamdagagi tuzilmalar erigan ruteniy atomlaridan hosil bo'lib sovutish jarayonida cho'kib qolgan klasterlar emas, balki legirlashda ishlatalgan dastlabki RuO<sub>2</sub> zarrachalarining o'zida mavjud (yoki yuzaga kelgan) bo'shlisi ehtimoli katta. Bunga ikki sabab bor:

1. Rentgen difraktsiyasi ushbu o'lchamdagagi kogerent tarqalish sohalarini aniqlashi mumkin, ammo bu sohalarning qanday atomlardan iborat ekanligini aniqlay olmaydi.

2. EXAFS usuli esa bunday sohalarning mavjudligini aniqlashi va qaysi atomlar atrofida hosil bo'layotganini aniqlashi mumkin. Xususan, Meneghini va boshqalarning [1] keltirilgan ishida EXAFS spektrлari aynan ruteniy atomlariga nisbatan olingan. Ammo shishada ruteniying past eruvchanligi ikki xil rol o'ynagan:

Natijada, EXAFS spektrлarida asosan dastlabki holatini saqlab qolgan RuO<sub>2</sub> aks etadi. Klasterlar esa ushbu spektrлarda (taxminan 1% yoki undan kamroq amplitudada, ruteniying shishadagi eruvchanligidan kelib chiqib) sezilarli o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Afsuski, bunday o'zgarishlarni usulning mavjud aniqligi bilan izohlashning imkon yo'q. Ushbu holatda yuqorida ta'kidlangan klasterlarni RuO<sub>2</sub> kukun zarrachalarining polikristalli tuzilishi natijasi sifatida ko'rish mumkin [3].

Faraz qilaylik [4], [5], shisha elektr o'tkazuvchanligi legirlash jarayonida ligatura atomlarining shishaga diffuziyasi tufayli oshadi. Ligaturaning har bir zarrachasi atrofida diffuziya zonasasi hosil bo'ladi, va cheksiz klaster endi ligatura zarrachalaridan emas, balki diffuziya zonalardan iborat bo'ladi. Elektron mikroskopik tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, maydalash jarayonida ligatura zarrachalar radiusi - r ga yaqin sferik shaklini qabul qiladi. Shishaning o'zi izotrop muhitdir. Shuning uchun diffuziya jarayoni ham izotrop bo'ladi va diffuziya zonasasi sferik bo'ladi (1 va 2-rasmlar). Ushbu zonasining hajmi

$$V_d = \frac{4\pi}{3} (l_d + r)^3 \quad (1)$$

eng oddiy holatda, T<sub>f</sub> haroratda, vaqt davomida τ, ligatura atomlari masofaga diffuziya qiladi

$$l_d = \sqrt{D\tau} = \sqrt{D_0\tau} \exp\left(-\frac{E_a}{2kT_f}\right) \quad (2)$$

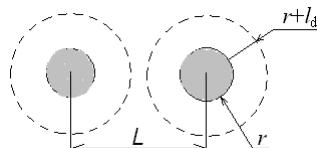
$E_a$  – diffuziya jarayonining aktivatsiya energiyasi,  $D_0 = D(T_f \rightarrow \infty)$ ,  $k$  – Boltzman doimisi. Chunki  $C = V_d / V_0$  va  $C_c = V_c / V_0$ , oqish nazariyasining [6-9] asosiy tenglamasini elektr o'tkazuvchanlik uchun quyidagicha yozish mumkin:

$$\sigma(V) = V_0^{-t} \sigma_0 (V - V_c)^t \quad (3)$$

Bu yerda ( $V_c$ ) – diffuziya zonasining kritik hajmi, ( $V_p$ ) – ligaturaning har bir zarrachasiga to'g'ri keladigan namunaviy hajm. (1) va (2) ni (3) ga qo'yib, oddiy algebraik o'zgartirishlardan so'ng quyidagi ega bo'lamiz:

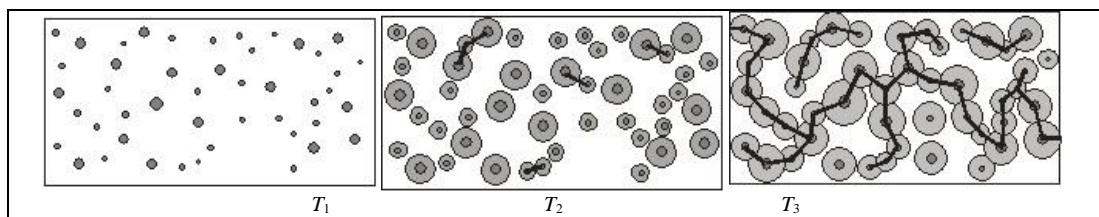
$$\ln \left\{ l_{d0} \left/ \left( \sqrt[3]{\frac{3V_0}{4\pi}} ((\rho / \rho_0)^{-1/t} + \frac{V_c}{V_0}) - r \right) \right\} \right\} = \frac{E_a}{2kT} \quad (4)$$

Bu yerda  $l_{d0} = \sqrt{D_0\tau}$ ,  $\rho_0 = 1/\sigma_0$  – butun hajm legirlangan shisha (diffuziya zonasasi) bilan to'ldirilgan holatda namunaviy solishtirma qarshilikni anglatadi, va moslashtirish parametri rolini bajaradi.



1-rasm. Ligatura zarrachalari va diffuziya zonasasi modeli (sxematik tarzda). Ligatura zarrachalari o'rtacha  $r$ -radiusga ega, diffuziya zonasasi esa  $-r+l_d$ .

2-



rasm.

Diffuziya natijasida legirlangan shishada oqish darajalarining hosil bo'lishi ( $T_1 > T_2 > T_3$ ),  $\tau = \text{const.}$

Ifoda (4) bizga diffuziya jarayonining aktivatsiya energiyasi  $E_a$  ni va diffuziya uzunligini  $l_d$  legirlash vaqtiga o'zgarmas bo'lganda,  $T_f$  haroratiga bog'liq holda aniqlash imkonini beradi.

Bundan tashqari, (4) ifodasi [10] turli xil shisha turlari, ligaturalar va legirlash rejimlari, shuningdek, kukunlarning dispersivligi uchun oqish chegarasi  $R(C)$  qanday va qanchalik o'zgarishi mumkinligini tushuntiradi. Darhaqiqat:

1) Shisha tarkibi va tuzilmasining o'zgarishi, shuningdek, ligatura turi bir xil legirlash rejimida diffuziya koefitsienti

$$D(T_f) = D_0 \exp(-E_a / kT_f) \quad \text{va diffuziya uzunligini} \quad l_d = \sqrt{D\tau} = \sqrt{D_0\tau} \exp(-E_a / 2kT_f) \quad \text{o'zgartiradi, bu esa shishaga yuqori elektr o'tkazuvchanlikka ega diffuziya zonasining hajmi ulushining o'zgarishiga olib keladi.}$$

2) Ligatura kukuni qancha mayda bo'lsa, legirlangan shisha hajm birligidagi zarrachalari soni shuncha ko'p bo'ladi va ular orasidagi o'rta masofa shunchalik kichik bo'ladi. Shu sababli, bu masofani ligaturaning diffuziya qiluvchi atomlari bilan qoplash va diffuziya zonalardan cheksiz klaster hosil qilish uchun boshqa barcha sharoitlar bir xil bo'lganda, kamroq diffuziya vaqtiga talab etiladi.

1-jadval. Qo'rg'oshin-silikat shishalarida ligatura atomlari uchun diffuziya koefitsientlari va aktivatsiya energiyalari, shuningdek, diffuziya uzunliklari [4]-[10].

Legirlangan shisha namunasasi	Shisha	Legirlangan shisha tarkibi, shisha mass, %	Ligatura	$E_a$ , eV	$D_0$ , $\text{cm}^2/\text{c}$	$l_d$ , cm, $T_f=1123$ K da
1	B-17M1	80	20	PbRuO <sub>3</sub>	1.08	$5.65 \cdot 10^{-8}$
2	B-17M1	90	10	RuO <sub>2</sub>	0.624	$9.48 \cdot 10^{-6}$
3	B-17M2	90	10	RuO <sub>2</sub>	0.194	$5.74 \cdot 10^{-4}$
4	B-17M2	80	20	RuO <sub>2</sub>	0.212	$4.1 \cdot 10^{-4}$

**Natijalar.** Endi legirlash darajasi va legirlash vaqtiga, ligatura zarralarining o'chamlari legirlashgan shisha namunasi elektr o'tkazuvchanligiga qanday ta'sir qilishini ko'rib chiqamiz [11]. Ligatura atomlarining shishada diffuziyasi, diffuziya zonasasi hajmiga teng bo'lgan zarrachalardan sodir bo'ladi va tashqi manbadan diffuziant oqimi yo'q. Shuning uchun diffuziya jarayonini cheklangan manbadan sodir bo'layotgan deb hisoblash mumkin [12], va Fik tenglamasidan foydalansh mumkin:

$$\frac{\partial N(x, \tau)}{\partial \tau} = D \frac{\partial^2 N(x, \tau)}{\partial x^2} \quad . \quad (5)$$

Diffuziya profili quyidagi funksiya bilan tavsiflanadi

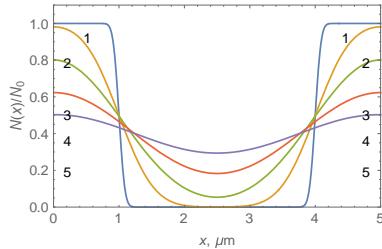
$$N(x, \tau) = \frac{N_0}{2} \left\{ \operatorname{erfc} \frac{x-r}{2\sqrt{D\tau}} - \operatorname{erfc} \frac{x+r}{2\sqrt{D\tau}} \right\} \quad (6)$$

Bu yerda  $N_0$  – ligatur atomlarining donadagi konsevtratsiyasi,  $r$  – ligatur donasining radiusi,  $\operatorname{erfc}(x, \tau)$  – xatolik funksiyasining qo'shimcha qismi,  $\tau$  – legirlash jarayonining davomiyligi. Diffuziya jarayoni uchun eng xususiy va eksperimental tekshiruv uchun qulay bo'lgan narsa diffuziya uzunligining vaqtga bog'liqligi hisoblanadi.

Diffuziya haroratiga bog'liq qarshilikka bog'liqlik uchun (yuqorida qarang, (4) ifodasi) qilinganidek, legirlashgan shishaning diffuziya jarayonining davomiyligiga bog'liq qarshilik  $R(\tau)$  uchun quyidagi ifodani olamiz:

$$(R / R_0)^{-1/t} = \frac{4\pi}{3V_0} (\sqrt{D\tau} + r)^3 - C_c \quad (7)$$

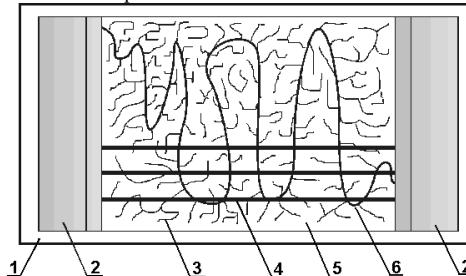
Legirlashgan shisha holatida, L masofasi bilan ajralgan qo'shni ligatur zarrachalari diffuziya jarayonining ikki cheklangan manbai sifatida ko'rib chiqilishi mumkin, ularning diffuziya oqimlari bir-biriga qarshi yo'nalgan. Shunday qilib, ligatur konsentratsiyasining ularning orasidagi taqsimlanishi vaqtning turli paytlarida, ligatur zarrachalarining ikki diametri va uning doimiy hajm kontenti uchun 5.5-rasmida ko'rsatilgan shaklga ega bo'ladi.



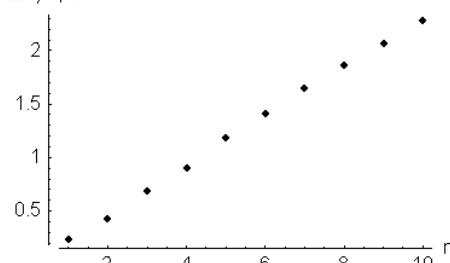
3-rasm. Ligatura atomlari konsentratsiya profili ikki ligatura zarrachasi orasida vaqtning quyidagi momentlarida:  $\sqrt{D\tau_1} = 0,05$ ;  $\sqrt{D\tau_2} = 0,3$ ;  $\sqrt{D\tau_3} = 0,55$ ;  $\sqrt{D\tau_4} = 0,8$ ;  $\sqrt{D\tau_5} = 1,05$ .

Ligatura zarrachalari radiusi (mkm): 0,5 (a); 1 (b). Zarrachalar markazlari orasidagi masofa – 5 mkm.

**Muhokama.** Diffuziya natijasida hosil bo'lgan diffuziya zonasini legirlashgan shisha namunasining barcha qismiga teng taqsimlanadi. Elektr o'tkazuvchanlik, shu diffuziya zonasida joylashgan turli zaryadli ligatura ionlari o'ttasidagi elektron almashinuvni orqali amalga oshiriladi, ya'ni tashuvchi zarralarning o'zining impuritet ostizona ichidagi harakati orqali. Shunday qilib, aynan ushbu impuritet ostizonaning eni  $m^*$  tashuvchi zarralarning samarali massasini belgilaydi: zona qanchalik tor bo'lsa,  $m^*$  shuncha katta bo'ladi [13]. Legirlashgan shisha holatida, ligaturanering shishadagi eruvchanligi yoki diffuziya legirlash darajasi past bo'lganda (taxminan 7% yoki kamroq, yuqoriga qarang), ligaturning qo'shni atomlari orasidagi o'rtacha masofa o'zining shisha atomlari orasidagi masofaga nisbatan katta bo'lib, ligatur qo'shni atomlarining to'qin funksiyalarining qoplam integrali kichik bo'ladi. Bu tor impuritet ostizoni va erkin tashuvchi zarralarning katta samarali massasiga olib keladi.



4-rasm. Kontaktlarga ega legirlangan shisha namunasi va cheksiz klaster (sxematiq tarzda). 1 – taglik (96%  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ), 2 – kontaktlar (kumush-vismut), 3 – o'lik uchlar, 4 – legirlangan shisha qatlamidagi kovaklar, 5 – legirlangan shisha, 6 – cheksiz klaster.



5-rasm. Legirlangan shisha namunasining qarshiligi kesilgan kovaklar soniga bog'liqligi.

Bizning nazarimizcha, ushbu maksimumming paydo bo'lishini ligatur zarrachalari orasidagi o'rtacha masofaning (sakrash yoki tunel qilish uzunliklari) o'zgarishi bilan izohlash mumkin emas, chunki aluminiy oksidi asosining issiqlik kengayish koefitsienti  $8,4 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$  C71-K shishasining esa  $7 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$  ga teng. Bu 700 K (o'tkazuvchanlikning pasayishi boshlanishi) dan 1000 K gacha bo'lgan harorat o'zgarishi bilan yuqorida aytilgan masofaning  $8,4 \times 10^{-6} \times 300 = 2,5 \times 10^{-3} = 0,25\%$ ga o'zgarishiga olib keladi. Bu yerda biz atrofdagi atomlar orasidagi masofaning o'zgarishi asosining issiqlik kengayishi natijasida yuz berishini qabul qildik, chunki plenka qalinligi asos qalinligidan deyarli 20 barobar kam, va oxirgisining Yung moduli qatlam modulidan sezilarli darajada yuqoriq. Shu bilan birga, tunel qilish (sakrash) ehtimoli va namunani o'tkazuvchanligi  $e^{-0.0025} = 1,0025$  martaga o'zgaradi, bu eksperimentda kuzatilganidan deyarli 4 tartib kichikroq. Bunday farq yana bir bor ko'rsatadi, legirlashgan shishaning o'tkazuvchanligi ligatura zarrachalaridan iborat uzlusiz sanjirlar (cheksiz klaster) hosil bo'lishidan ko'ra, bosqua omillar (xususan, shishanang diffuziya legirlashini natijasida u o'tkazuvchi bo'lishi) bilan bog'liq.

**Xulosa.** Shisha va ligaturukunlari aralashmasining legirlash paytida ligatura atomlarining shishada diffuziyasi sodir bo'ladi. Shishada hosil bo'lgan diffuziya zonalari, shishaga nisbatan yuqori (shishaga nisbatan) o'tkazuvchanlik va ligaturaga nisbatan katta hajmiga ega bo'lib, diffuziya mavjud bo'lmagan holatga nisbatan kamroq ligatura tarkibida cheksiz klasterni hosil qilishi mumkin. Ligatura atomlarining diffuziya uzunligi va shu bilan birga diffuziya zonasini hajmi harorat va diffuziya davomiyligi oshishi bilan o'sadi, shuningdek, shisha va ligatura tarkibiga bog'liq bo'ladi.

1. O'tkazuvchanlik sohalarining (legirlangan sohalar) hajmini harorat, davomiylik va legirlash darajasi, shuningdek, ligatura zarrachalarining o'lchamlari bilan bog'laydigan ifodalar olinib, legirlashgan shishaning o'ziga xos qarshiligini o'lchash orqali diffuziya jarayonining parametrlarini (diffuziya koefitsienti, faollashish energiyasi va diffuziya uzunligi) aniqlash mumkin bo'ldi. Natijada, o'tkazilish egrisining nazariy qiymatiga nisbatan legirlash darajasi (ligatura tarkibi) pastroq darajaga siljiydi.

2. Muayyan sharoitlarda diffuziya zonasini namunani butun hajmiga egallashi mumkin, va bu holda o'tkazilish darajalari va cheksiz klaster haqida gapirish ma'nosiz bo'ladi, balki legirlashgan shishani yuqori o'tkazuvchanlikka ega yangi material sifatida ko'rib chiqish kerak. Aynan ligatura atomlarining diffuziyasi o'tkazilish egrisining legatura tarkibini kamaytirishga yoki ushbu egri yo'qligiga olib kelishini, shishaning va ligaturaning tarkibi, legirlash davomiyligi va harorati parametrlariga ta'sirini tushuntiradi; bu legirlashgan shishadan nominal aniqlik va bo'linish koeffitsienti  $\pm 0,01\%$  dan yaxshiroq rezistorlar va kuchlanish bo'luvchilarini ishlab chiqishga imkon beradi.

#### ADABIYOTLAR

1. Aburakhmanov G., Amanov Sh. High voltage ceramic isolators with resistive layer for potential linearizing// Proceedings 7- ISAM, September 2001. – Islamabad (Pakistan), 2001.-pp. 84-89.
2. Абдурахманов Г., Абдурахманова Н.Г., Вахидова Г.С. О состоянии частиц двуокиси рутения в толстопленочных резисторах // Фундаментальные и прикладные вопросы физики: Материалы международной конференции. - Ташкент, 2006. - С. 331-335.
3. Абдурахманов Г. Влияние диффузии на порог протекания в толстопленочных резисторах // Uzbek Journal of Physics. – Tashkent, 2009. – vol. 11, N 3. - pp. 207-211.
4. Абдурахманов Г., Вахидова Г. С. Диффузия и электропроводность в толстопленочных резисторах // ДАН РУз - Ташкент, 1995. - №1. – С. 19-21.
5. Абдурахманов Г., Вахидова Г. С. Диффузия и электропроводность в толстопленочных резисторах // ЖТФ. – С.-Петербург, 1995. - Т. 65, в.7. – С. 187-190.
6. Займан Дж. Модели беспорядка. Пер. с англ. – М.: Мир, 1982. – 592 с.
7. Бонч-Бруевич В. Л., Звягин И. П., Кайпер Р., Миронов А. Г., Эндерлайн Р., Эсер Б.-М. Электронная теория неупорядоченных полупроводников / Под ред. В. Л. Бонч-Бруевича - М.: Наука, 1981. – 384 с.
8. Шкловский Б.И., Эфрос А.А. Электронные свойства легированных полупроводников. – М.: Наука, 1979. – 416 с.
9. Мотт Н., Дэвис Э., Электронные процессы в некристаллических веществах. В 2-х т. Пер. с англ. – М.: Мир, 1982. – 664 с.
10. Abdurakhmanov G., Vakhidova G. Diffusion of RuO<sub>2</sub> and PbRuO<sub>3</sub> into Lead Silicate Glasses // MRS Fall Meeting, Boston, USA, 27 November - 1 December 1995.
11. [11]. Донован Р. П., Смит А. М., Бэрри Б. М. Окисление, диффузия, эпитаксия / Под ред. Бургера Р. и Донована Р. Пер. с англ. – М.: Мир, 1969. – 451 с.
12. Lee J., West R.W. Firing studies with model thick film resistor systems // IEEE Trans. Comp. Hybrids and Manufact. Technol. – Urbana (IL, USA), 1983. – vol. CHMT-6, N 4. - pp. 430-435.
13. Фельц А. Аморфные и стеклообразные неорганические твердые тела. Пер. с нем. - М.: Мир, 1986. – 558 с.